

МЕЖЭЛЕКТРОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОБЛАСТИ ПОРОГА ПОЯВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕСОРБЦИИ

В. Н. А г е е в, А. М. М а г о м е д о в,
Б. В. Я к ш и н с к и й

Впервые обнаружен порог появления электронно-стимулированной десорбции при энергии электронов выше энергии ионизации оставного уровня, который интерпретирован на основе двухэлектронной ионизации атома.

Электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) широко используется для изучения адсорбции, однако механизм этого явления еще не достаточно ясен [1]. Многие экспериментальные факты по ЭСД удается объяснить, предполагая, что первичное электронное возбуждение возникает в результате образования вакансии на оставном уровне атомов адсорбционной системы, внутриатомный или межатомный Оже-распад которой приводит к кулоновскому расталкиванию соседних ионов [2]. При удалении ионов от поверхности необходимо учитывать релаксацию заряда ионов на поверхности [3].

В большинстве использовавшихся для ЭСД адсорбционных систем энергии ионизации оставных уровней атомов были относительно малы и близки по величине, что затрудняет однозначную интерпретацию первичного электронного возбуждения. Поэтому для исследований была использована текстурированная вольфрамовая лента с моноатомной пленкой кремния, на которую напылялись субмонослойные покрытия лития. В этой адсорбционной системе энергии ионизации оставных уровней элементов существенно различаются.

Экспериментальная установка, детально описанная ранее [3], совмещала статический магнитный масс-спектрометр с энергоанализатором с задерживающим электрическим полем.

При облучении электронами адсорбционной системы $W - Si - Li$ наблюдалась эмиссия ионов Li^+ . На рисунке представлен график зависимости выхода q^+ (ион/эл-н) ионов Li^+ от энергии E , бомбардирующих поверхность электронов. Шкала энергий электронов отсчитывается от уровня Ферми и скорректирована на контактную разность потенциалов между эмиттером электронов и мишенью. Концентрация напыленного Li составляла $\sim 2 \cdot 10^{14}$ ат/см², что соответствует линейной области зависимости q^+ от концентрации адсорбированного Li . На графике виден очень резкий порог при $E \approx 133$ эВ и более плавное увеличение нарастания q^+ при $E > 154$ эВ. Следует отметить, что при $E \approx 154$ эВ увеличение q^+ напоминает обычное увеличение сечения ионизации с ростом E , однако в области порога нарастание q^+ значительно круче. Значение $E \approx 154$ эВ хорошо коррелирует с табличным значением энергии фотоионизации уровня $2\ s Si$, однако величина энергии

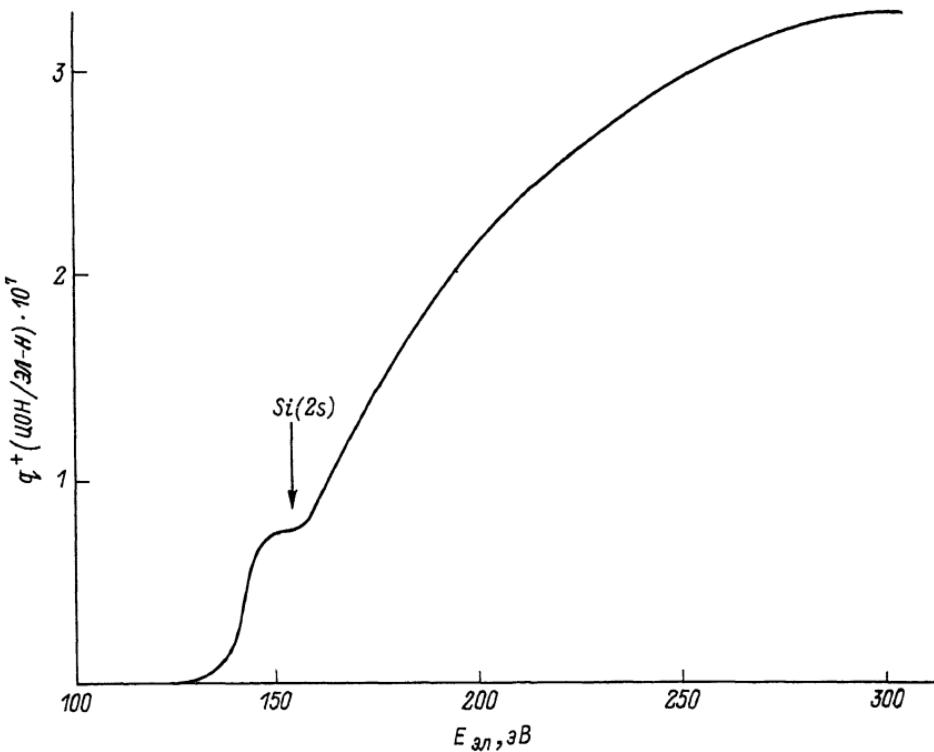


График зависимости q^+ выхода ионов Li^+ при ЭСД из адсорбционной системы $W - Si - Li$ от E энергии бомбардирующих электронов. Концентрация лития на поверхность $2 \cdot 10^{14}$ ат/см 2 . Ток бомбардирующих электронов 10^{-6} а. Шкала энергий скорректирована на работу выхода эмиттера электронов 4.5 эВ.

133 эВ не соответствует энергиям ионизации оставшихся уровней элементов адсорбционной системы $W - Si - Li$ [4].

Другая удивительная черта графита — отсутствие порогов появления ионов Li^+ при энергии ионизации $1s Li \sim 56$ эВ и $2p Si \sim 102$ эВ [4], хотя Оже-переходы являются наиболее интенсивными с участием этого уровня Si [5].

По-видимому, эти особенности q^+ выхода ионов Li^+ от E связаны с сильной локализацией валентных электронов W и Li на Si . Это предположение подтверждается увеличением работы выхода W на 0.43 эВ при напылении монослоя Si и уменьшением работы выхода на 1.7 эВ при напылении монослоя Li поверх монослоя Si . В этом случае обычный Оже-распад оставшейся вакансии на уровне $2p Si$ не может обеспечить положительного заряда на Si , который необходим для удаления ионов Li^+ [2, 3]. Удаление трех электронов из иона Si может быть обеспечено только в результате двойной ионизации с последующим Оже-распадом.

Точный энергетический расчет двойной ионизации отрицательного иона Si^- в системе $W - Si - Li^-$ представляет сложную задачу, поэтому ограничимся оценками необходимой энергии. Энергия удаления электрона из 2p оболочки Si^- увеличивается на 31 эВ для возрастания заряда ядра на единицу [4], а потенциал ионизации иона Si^{+} составляет 16 эВ [6]. Реальное значение энергии двойной ионизации в нашем случае лежит между этими величинами, что согласуется с наблюдаемым увеличением энергии порога появления ЭСД ионов Li^+ на ~ 30 эВ по отношению к энергии фотоионизации уровня 2p Si^- . Двойная ионизация, являясь процессом удаления из атома двух электронов одним электроном, должна иметь более резкую зависимость сечения от энергии Е по сравнению с сечением однократной ионизации [7], что также соответствует наблюдаемому ходу зависимости $q^+ = f(E)$ в области порога.

При ионизации 2s уровня Si^- заполнение оставной вакансии может сопровождаться каскадным Оже-процессом $L_1 L_{2,3} V$, $L_{2,3} IV$, что приводит к удалению из иона Si^- трех электронов и объясняет особенность на графике $q^+ = f(E)$ при энергии ионизации 2s уровня Si^- .

С другой стороны, межатомный Оже-распад вакансии на 1s уровне Li^- может привести к удалению только двух электронов из иона Si^- , что недостаточно для ЭСД ионов Li^+ .

Таким образом, обнаружено не наблюдавшееся ранее явление влияния межэлектронных взаимодействий при электронной ионизации атомов на порог появления ионов при ЭСД.

Авторы выражают благодарность О.В. Константинову за обсуждение результатов работы.

Список литературы

- [1] Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А. В сб.: Проблемы физической электроники, Л.: ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 1987. С. 18.
- [2] Копотек М.Л., Feivelman P.J. // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 40. P. 964.
- [3] Агеев В.Н., Бурмистрова О.Р., Yakshinskii B.V. // Surf. Sci. 1988. V. 194. P. 101.
- [4] Бриггс Д., Сиха М.П. Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. М.: Мир, 1987. 567 с.
- [5] Агеев В.Н., Афанасьева Е.Ю., Гальпль Н.Р., Михайлов С.Н., Рутъков Е.В., Тонтего-де А.Я. // Поверхность. 1987. Т. 5. С. 7.
- [6] Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 107 с.
- [7] Хастед Дж. Физика атомных столкновений. М.: Мир, 1965. 319 с.